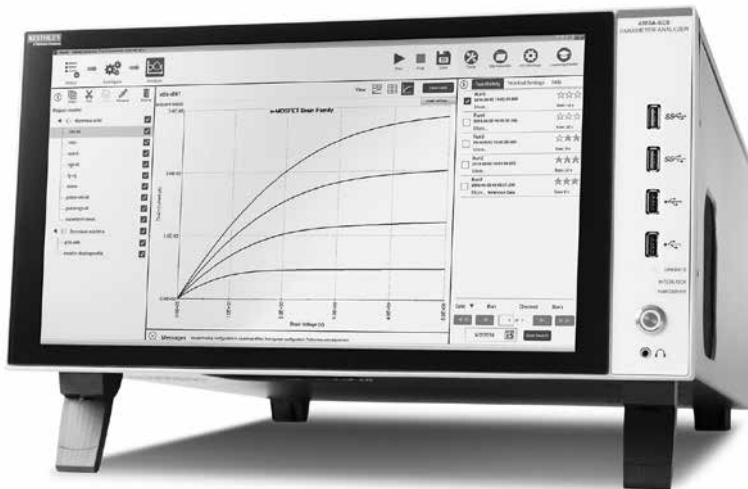


일리노이대, 나노제조기술 연구실 장비를 텍트로닉스로 선정

- 학부 수준 실험실 최초로 학생들에게 최상위 수준의 실험·실습 경험을 제공하기 위해 키슬리 4200A-SCS 파라미터 애널라이저를 도입



4200

텍트로닉스가 일리노이대학교(University of Illinois) 전기 및 컴퓨터공학 전공의 나노제조기술 실험실(Nano-fabrication Lab)에서 학사 과정 최초로 학생들에게 최상위 수준의 마이크로 및 나노 전자공학 실험·실습 경험을 제공할 수 있도록 키슬리 4200A-SCS 파라미터 애널라이저 3대 및 4200A-CVIV 멀티 스위치 모듈 3대를 도입했다고 발표하였다. 4200A-SCS는 소재, 반도체 디바이스 및 프로세스의 전기적 특성을 분석하기 위해 완벽하게 통합된 모듈형 파라미터 애널라이저이다.

4200A-CVIV는 DC 및 AC 측정 간 전환 및 다른 테스트 디바이스의 터미널로 AC 측정 이동을 오류 없이 수행할 수 있다.

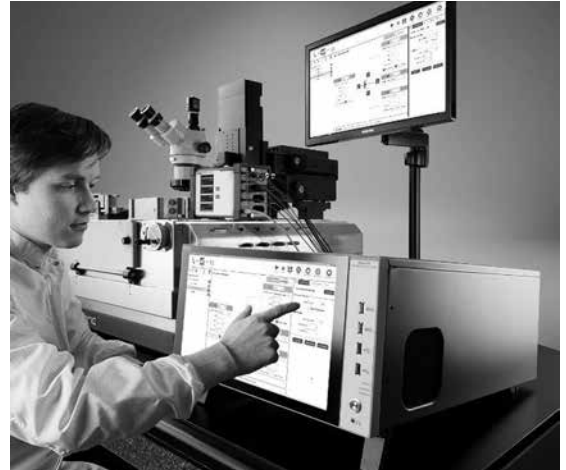
일리노이대학교는 230,000평방 피트 규모의 ECE 빌딩에 나노제조기술 연구실을 구축하는 중이다. 이 새로운 시설에는 학생들에게 전자공학 및 컴퓨팅 분야의 충분한 실험·실습 경험을 제공할 수 있도록 20개 이상의 전용 실험실을 준비하고 있다. 일리노이대학교가 텍트로닉스 4200A-SCS를 선택한 이유는 장비를 처음 사

PROCESS CONTROL INSTRUMENTATION

용하는 연구원이나 학생들이라도 장비를 쉽게 사용할 수 있고, 최소한의 교육으로도 실무에 즉시 활용할 수 있는 큰 장점이 있기 때문이다. 이처럼 4200A-SCS는 다음과 같은 기능으로 “사용성(Usability)”에 중점을 두고 있다.

- 텍트로닉스 홈페이지에서 애플리케이션 노트 및 웨비나 제공, 유튜브(YouTube)에서 테스트 설정부터 측정 실행과 문제 해결 관련 지침을 비디오로 제공(한국어·영어·일본어·중국어 지원 가능)
- 바로 사용 가능(Ready-to-use)하고, 사용자가 수정 가능한(User-modifiable) 450개 이상의 애플리케이션 테스트 및 디바이스를 제공하여 테스트 계획 개발에 용이
- 시각적 테스트 계획 개발 및 테스트 시퀀싱 도구
- 통합된 신뢰성 검증 기능으로 프로브가 웨이퍼 패드에 접촉했을 때 사용자에게 확인 가능

데인 시버스(Dane Sievers) 교수는 “키슬리 4200A-SCS는 첨단 파라미터 기능과 사용성의 이상적인 조합을 제공하는 것이 입증된 장비다”면서, “실제로 사용해 보니, 장비의 작동이 굉장히 직관적이기 때문에 교육 없이도 어렵지 사용할 수 있었다”고 평했다.



텍트로닉스의 키슬리 PL 총 책임자인 마이크 플래티(Mike Flaherty)는 “파라미터 애널리저 사용 경험이 없는 유저라도 4200A-SCS를 굉장히 쉽게 설정하고 익힐 수 있도록 만들기 위해 최선을 다했다”면서, “4200A-SCS의 훌륭한 사용성 덕분에 이 제품은 반도체 디바이스 연구, 디바이스 결함 분석 및 신뢰성 테스트 등의 애플리케이션뿐 아니라 일리노이대학교가 구축 중인 것처럼 여러 사용자를 위한 공유 리소스로 사용되는 교육 실험실에도 적합할 것이다”라고 언급했다.

텍트로닉스에 대하여

텍트로닉스는 지난 70여 년간 혁신의 중심에 서왔습니다. “오실로스코프를 사용하는 전 세계 엔지니어 10명 중 8명은 텍트로닉스의 제품을 사용한다”는 말이 있을 정도로 텍트로닉스(Tektronix)는 오실로스코프를 필두로 T&M (Test & Measurement) 분야에서 강력한 리더십을 발휘하고 있다. 보다 자세한 사항은 kr.tek.com을 확인 바란다.